InGaN 薄膜的紫外共振喇曼散射*

王瑞敏† 陈光德

(西安交通大学理学院大学物理部,西安 710049) (2008年5月26日收到 2008年8月21日收到修改稿)

利用 325 nm 紫外光激发,对不同组分的 $In_x Ga_{1-x}N$ 薄膜的喇曼散射谱进行了研究.在光子能量大于带隙的情况下 观察到显著增强的二阶 A_1 (LO)声子散射峰.二阶 LO 声子峰都从一阶 LO 声子的二倍处向高能方向移动 移动量随样品 In 组分的增加而增大,认为是带内 Fröhlich 相互作用决定的多共振效应引起的.分析了一阶 LO 声子散射频率和峰型与 In 组分的关系.在喇曼谱中观察到样品存在相分离现象,并与 X 射线衍射的实验结果进行了对比.此外,还观察到位于 1310 cm⁻¹附近的 $In_x Ga_{1-x}N$ 的 E_2 声子组合模.

关键词:In_xGa_{1-x}N 合金,紫外共振喇曼散射,二阶声子,相分离 PACC:7830,7280E

1.引 言

三元合金 In, Ga1-, N 在室温下具有 1.95-3.39 eV 的直接带隙,它非常适合作为蓝光区 LED 和 LD 的有源区,所以生长高质量的 In, Gai, N 合金是制 造氮化物发光器件的关键技术[1] 因为材料的基本 性质对发光器件的性能有直接影响 ,所以近年来对 三元合金 In. Gai___N 基本性质的研究引起了很大的 关注.由于相分离现象的存在,高 In 组分的样品生 长较困难,目前关于高组分 In, Ga1_, N 中声子行为 的报道很少,声子频率与组分的关系还没有完全建 立 而对于 In_xGa_{1-x}N 中高阶声子特性的研究更是 缺乏.在可见光激发的情况下, In, Ga1-, N 的喇曼谱 中往往存在比较强的发光背景,严重影响对声子散 射峰的观察,采用紫外光激发首先可以有效地避开 荧光干扰 淇次 由于紫外光穿透深度较小 散射信 号主要来自表面外延层,避免了衬底和缓冲层信号 的影响;同时,通过共振效应使散射效率大大增强, 为观察高阶声子的散射特性提供了可能²¹.

本文利用 325 nm 紫外光激发,对不同组分的 In_xGa_{1-x}N 薄膜样品的喇曼散射谱进行了研究.观察 到显著增强的二阶 LO 声子的散射峰,对二阶声子 的散射特性及其在大于带隙情况下的共振增强机理 进行了讨论.分析了一阶 LO 声子的散射频率、散射 峰型与组分的关系.观察了 In_xGa_{1-x}N 合金中存在 的相分离现象,并与 X 射线衍射的实验结果进行了 对比分析.

2. 实 验

实验所用的六方相 $In_x Ga_{1-x} N$ 薄膜样品利用 MOCVD 法在蓝宝石衬底(0001)面上生长,衬底和 InGaN 外延膜之间存在一层 GaN 缓冲层.样品 A 的 InGaN 外延膜厚度约 1 μ m 左右,样品 C ,D 的 InGaN 层厚度为 0.2 μ m 样品 B 的外延膜厚度小于 40 nm. 合金组分通过 X 射线衍射实验确定^[3]:样品 A 中 x = 0.03 样品 B 中 x = 0.09;样品 C ,D 存在明显相 分离现象,样品 C 中 3 个衍射峰对应的组分为 x =0.26 0.15 0.06;样品 D 中为 x = 0.26 0.16 0.09.

喇曼光谱测量采用 Jobin-Yvon T64000 型共焦显 微拉曼光谱仪 ,Z(X –)Z 背散射配置.激发光采用 325 nm 紫外光激发,激发光到达样品表面的功率约 1.7 mW 左右.325 nm 谱线激发下光谱分辨率为 2 cm⁻¹左右.实验均在室温下进行.

3. 结果与讨论

图 1 为 Z(X –)Z 配置下得到的 4 块 $\ln_x Ga_{1-x} N$

^{*} 国家自然科学基金(批准号:10474078)和陕西省自然科学基金(批准号:2004A01)资助的课题.

[†] E-mail :wangrm@mail.xjtu.edu.cn

射 A₁(LO) A₁(LO) A₁(LO) A₁(LO) 1310

样品A

样品B

<u></u> 牟品(

high-sin-1444

样品D

1000

Raman 频移/cm⁻¹

1200

1400

1600

 E_2^H

遇度

400

600

800

样品的喇曼散射谱 根据选择定则该配置下可以观 察到 E₂ 和 A₁(LO)模.采用 325 nm 紫外光激发,由 于 A_i(LO)模接近共振,所以与可见光激发情况不 同^[4] A₁(LO) 模散射强度明显大于 E₂ 模.在图中还 可以观察到非常强的二阶 A₁(LO)声子散射峰,其散 射强度接近一阶声子的 2 倍, 散射峰形和半高宽也 与一阶声子接近,完全没有声子态密度的特征,我们 认为这是与带内 Fröhlich 相互作用相关的多共振效 应引起的[56].半导体中,由于激子效应可以在导带 底以下形成一系列分立的束缚激子能级;由于电子-空穴对非束缚的库仑相关作用,也可以在带隙以上 形成激子连续带(如图 2). 根据 In 组分估算^[7],实验 所用的 4 块 In, Ga1-, N 样品的带隙在 3.4-2.5 eV, 入射光子能量为 3.81 eV 大于带隙,当入射光子能 量进入连续吸收带时,可能产生多共振效应^[8].二阶 散射过程对声子波矢没有要求 此时连续带和不同 的激子基态、激发态都可能作为散射中间态参与散 射 使二阶散射效率表达式中的几个能量分母同时 达到共振,从而使二阶声子散射效率明显增强.对于 极性 LO 声子 电子和声子间的耦合以 Fröhlich 相互 作用为主 这种相互作用依赖于声子波矢 a^{-1} .因为 声子能量远小于带间电子跃迁能量 因此该过程主 要由带内 Fröhlich 相互作用决定, 如图 2, 散射过程 中,首先吸收入射光子,产生一个α态的激子;第二 步 通过电子-声子的 Fröhlich 相互作用 发射一个波 矢为 q 的 LO 声子 激子跃迁到 β 态 再通过电子-声 子作用发射另一个波矢为 - q 的 LO 声子,激子跃 迁到 γ态 最后激子复合 产生一个散射光子.在这 些过程中 实的激子态充当了散射中间态 因而散射 效率显著增强.因为散射过程与波矢 q 有关,所以 要确定连续带或激子基态、激发态作为中间态参与 散射的概率比较困难,但由于 Fröhlich 相互作用一 般将声子波矢限制在比较小的范围内(远小于布里 渊区边界波矢)^{9]} 因此认为 在我们的实验中 连续 带充当散射中间态的贡献起主要作用.对于 Fröhlich 相互作用决定的小波矢声子的二阶散射,入射光子 能量在连续吸收带中时,满足多共振条件的声子散 射强度会显著增强,出现大于一阶声子散射强度的 锐峰型散射峰.

表 1 给出了 4 个样品 A, B, C, D的一阶和二阶 LO 声子散射峰的中心频率.可以看出,随样品 In 组 分的增加,一阶和二阶 A₁(LO)声子频率均向低能方 向移动.表1中ω₂₁₀ – 2ω₁₀表示二阶 LO 声子频率与





图 2 多共振二阶喇曼散射过程示意图

一阶声子频率的二倍之差.由此看出,实验测得的二 阶声子散射峰均从一阶声子的二倍处向高能方向移动移动量都在10 cm⁻¹以上,这远大于实验测量误差.并且,这个差值随样品中 In 组分的增加而增大, 对于 In 组分较高的 C,D 两个样品,二阶声子峰从一 阶声子的二倍处向高能方向分别移动了 26.4 cm⁻¹ 和 24.9 cm⁻¹.文献 10 报道在采用接近出射共振的 能量(2.6 eV)激发时,观察到 In_xGa_{1-x}N 的二阶 LO 声子散射峰向低能方向移动,文献[11]也报道在 488 nn(2.54 eV)激发下,GaN 的二阶 A₁(LO)声子频 率比带中心一阶 A₁(LO)声子频率的二倍小,认为是 布里渊区边界附近声子参与散射的结果,我们在采

 $2A_1(LO)$

58 卷

用大于带隙的光子能量激发时,得到的结果与上述 报道刚好相反,二阶声子散射峰向高能方向移动,我 们认为这是小波矢声子参与的多共振效应引起的. 随样品 In 组分的增加,带隙减小,此时入射光子能 量远大于带隙,二阶声子散射峰的蓝移量增大.

表 1 一阶和二阶 LO 声子的中心频率

	А	В	С	D
$\omega_{2L0}/\mathrm{cm}^{-1}$	1471.6	1470.4	1469.2	1467.7
$\omega_{\rm L0}/{\rm cm}^{-1}$	730.3	727.8	721.4	721.4
($\omega_{2LO} - 2\omega_{LO}$)/cm ⁻¹	11.0	14.8	26.4	24.9

图 1 内插图中给出了一阶 A₁(LO)声子的散射 谱,由图中可以看出,随 In 组分的增加 A₁(LO)散射 峰向低能方向移动,并且峰形明显加宽.目前的理论 计算和实验研究结果^[12-14]都表明 InGaN 的 A₁(LO) 模具有单模行为,随 In 组分的增加,A₁(LO)模向低 频方向移动,这与我们的观察结果一致.其中样品 B 在 736.7 cm⁻¹处还存在一个峰,这个散射峰是由 GaN 缓冲层产生的.这是因为样品 B 的外延层比较 薄,所以散射谱中存在来自缓冲层的信号. In 组分 较高的样品 C 和 D 的散射峰在低能方向存在拖尾, 表现出明显的不对称线形,一般认为 InGaN 样品中 组分不均匀或应力分布不均都会引起散射峰的不对 称 而目前知道对于生长在 GaN 缓冲层上 ,In 组分 为 0.1 < x < 0.4 的 InGaN 样品的临界厚度为 150—5 nm^[15].我们所用样品 C ,D 的厚度为 200 nm ,大于临 界厚度,可以认为外延层中应力是松弛的,应力对散 射峰的影响不大,因此,我们认为散射峰低能方向的 拖尾是相分离现象引起的,为此,我们利用 X 射线 衍射对样品的 In 组分进行了分析,图 3 给出了样品 D的X射线衍射谱和A(LO)声子的喇曼散射谱.图 \mathfrak{X} a)是 XRD2 θ - ω 扫描的结果 我们利用 4 个高斯曲 线对实验结果进行了拟合,得到4个衍射峰的位置 分别为:33.664°,33.998°,34.267°和 34.579°.其中 34.579°为 GaN 缓冲层的(0002)衍射峰,其余 3 个为 In, Ga1-, N 的(0002) 衍射峰 根据 Vegard 定律计算得 到这 3 个衍射峰对应的 In 组分 x 分别为 0.26 0.16 和 0.09.分析结果显示,样品 D 存在相分离现象, In_xGa_{1-x}N材料较大的固溶隙是导致相分离的主要 原因



图 3 样品 D 的 X 射线衍射谱(a)和 A,(LO)声子的喇曼散射谱(b) 图中矩形点为实验测量数据,实线和虚线为拟合结果

表 2 样品 C 和 D 中 A₁(LO) 声子频率的计算结果 和实验拟合结果的对比^{a)}

样品	x	ω_1	ω_2	$\omega_{ m R}$	Δ_1	Δ_2			
D	0.09	723.3	722.6	724.9	1.6	2.3			
	0.16	714.6	712.2	710.9	3.7	1.3			
	0.26	701.7	697.3	679.4	22.3	17.9			
С	0.06	726.9	727.1	727.8	0.9	0.7			
	0.15	715.8	713.6	717.3	1.5	3.7			
	0.26	701.7	697.3	692.4	9.3	4.9			

a) ω_1, ω_2 表示公式(1)和(2)的计算结果; ω_R 表示喇曼实验拟合结果; $\Delta_1 = |\omega_1 - \omega_R|, \Delta_2 = |\omega_2 - \omega_R|$

图 3(b)为样品 D 的 A₁(LO)声子的喇曼散射 谱,由于采用 325 nm 光激发,穿透深度较小,谱中没 有 GaN 缓冲层的信号.我们利用 3 个洛伦兹曲线对 实验数据进行了拟合,得到的 3 个散射峰分别位于 679.4 710.9 和 724.9 cm⁻¹.目前已报道的 In_x Ga_{1-x} N 中 A₁(LO)声子频率随 In 组分变化的经验公式有^[14]

$$\omega = 734 - 144x + a_1 x (1 - x), \quad (1)$$

及[13]

$$\omega = (736 \pm 1) - (149 \pm 2)x.$$
 (2)

公式(1)中对 $0 \le x \le 0.30$ 的样品 $,a_1 = 27(\pm 3)$.根 据 X 射线衍射测量得到的样品 C 和 D 的 In 组分 x, 我们分别利用(1)和(2)式计算了 A₁(LO)声子频率, 并将计算结果与喇曼实验拟合结果进行了对比,对 比结果列于表 2 中.由表 2 中的数据可以看出,在 In 组分较低的情况下,两个公式的计算结果与实验数 据均能较好地符合,而当 In 组分 x 接近 0.3 时,两 个样品中计算结果与实验数据的误差都明显地增 大,这可能是因为上述经验公式都是在 x < 0.3 的样 品中得到的.因此,对于 In 组分较大的情况下 A₁(LO)声子的特性,还需要做进一步的研究.



图 4 不同组分 In_x Gal-xN 样品的组合模

由图 4 可以看出,散射谱中 1310 cm⁻¹附近存在 一个弱峰.其中样品 A 中此峰较明显,随样品 In 组 分的增加,这个峰的散射强度减弱并略向低能方向 移动.文献 16 曾报道在 GaN 中 1313 cm⁻¹处观察到 一个峰,这与我们观察到的散射峰位置相近.由于 1313 cm⁻¹处的峰在 A₁, E₁ 和 E₂ 对称性的谱中都出 现,且在 A₁ 对称性的谱中散射强度较大,因此认为 可能是由带边声子产生的 A₁ 或 E₁ 或 E₂ 声子的组 合模.文献 11 报道 GaN 的二阶谱中 1318 cm⁻¹处存 在一个弱峰,认为是 E₂ 声子的组合模.目前在 In_xGa_{1-x}N 材料中,关于二阶声子组合模的报道非常 少.从我们采用的实验配置 Z(X –)Z 看,观察到 E₁ 声子组合模的可能性很小.而如果 1310 cm⁻¹是 A₁ 声子的组合模,在采用 325 nm 紫外光激发的情况 下,应该得到共振增强.但此峰散射强度并未增强, 因此我们认为它是 E₂ 声子的组合模.在图 1 中可以 观察到 随样品 In 组分的增加,E₂ 声子散射峰向低 能方向移动,因而其组合模也向低能方向移动.

4.结 论

在大于带隙能量激发下,4个组分不同的 In_xGa_{1-x}N样品的喇曼谱中均出现明显增强的二阶 A₁(LO)声子散射峰,其散射强度接近一阶声子的2 倍,散射峰形和半高宽与一阶声子相似,且都从一阶 声子的二倍处向高能方向移动,移动量随样品中 In 组分的增加而增大,认为这是带内 Fröhlich 相互作 用决定的多共振效应引起的.

随样品 In 组分的增加 ,A_i(LO)声子频率向低能 方向移动.样品 C和 D的散射峰在低能方向存在拖 尾 ,表现出明显的不对称线形 ,X 射线衍射和喇曼散 射结果都显示样品存在相分离现象.根据声子频率 随 In 组分变化的经验公式的计算结果与喇曼实验 结果的对比显示 ,In 组分较低时两者符合较好 ,当 In 组分接近 0.3 时 ,误差明显增大.

4 个样品的喇曼谱中,在 1310 cm⁻¹附近都存在 一个弱峰,随 In 组分增加,这个峰的散射强度减弱 并略向低能方向移动,认为它是 E₂ 声子的组合模.

- [1] Lin T Y 2003 Appl. Phys. Lett. 82 880
- [2] Xiong G, Li C 2000 J. Light Scattering 12 71 (in Chinese] 熊 光、李 灿 2000 光散射学报 12 71]
- [3] Ding Z B, Wang Q, Wang K, Wang H, Chen T X, Zhang G Y, Yao S D 2007 Acta Phys. Sin. 56 2873(in Chinese)[丁志博、王琦、王坤、王欢、陈田祥二义、姚淑德 2007 物理学报

56 2873]

- [4] Wang R M, Chen G D, Zhu Y Z 2006 Acta Phys. Sin. 55 914(in Chinese] 王瑞敏、陈光德、竹有章 2006 物理学报 55 914]
- [5] Garcia-Cristobal A, Cantarero A, Trallero-Giner C, Cardona M 1994 Phys. Rev. B 49 13430
- [6] Alexandrou A , Pusep Y , Cardona M 1989 Phys. Rev. B 39 8308

- [7] Jain S C , Willander M , Narayan J , van Overstraeten R 2000 J. Appl. Phys. 87 965
- [8] Cardona M 1975 Light Scattering in Solids (New York : Springer) p138
- [9] Richard M M 1974 Phys. Rev. B 10 2620
- [10] Hernandez S , Cusco R , Pastor D , Artus L , O 'Donnell P K , Martin W , Watson I M , Nanishi Y , Calleja E 2005 J. Appl. Phys. 98 013511
- [11] Murugkar S , Merlin R , Botchkarev A , Salvador A , Morkoc H 1995
 J. Appl. Phys. 77 6042
- [12] Grille H , Schnittler C H , Bechstedt F 2000 Phys . Rev . B 61 6091

- [13] Correia M R ,Pereira S ,Pereira E ,Frandon J ,Alves E 2003 Appl. Phys. Lett. 83 4761
- [14] Kasic A, Schubert M, Off J, Kuhn B, Scholz F, Einfeldt S, Bottcher T, Hommel D, As D T, Kohler U, Dadgar A, Krost A, Saitoy, Nanishi Y, Correia M R, Pereira S, Darakchieva V, Monemar B, Amano H, Akasaki I, Wagner G 2003 Phys. Stat. Sol. (c) 0 1750
- [15] Kontos A G , Raptis Y S , Pelekanos N T , Georgakilas A , Bellet-Amalric E , Jalabert D 2005 Phys. Rev. B 72 155336
- [16] Siegle H , Kaczmarcayk H , Filippidis L , Litvinchuk A P , Hoffmann A , Thomsen C 1997 Phys. Rev. B 55 7000

Ultraviolet resonant Raman scattering in InGaN films *

Wang Rui-Min[†] Chen Guang-De

(School of Science , Xi 'an Jiaotong University , Xi 'an 710049 , China)
 (Received 26 May 2008 ; revised manuscript received 21 August 2008)

Abstract

Ultraviolet Raman scattering spectra of $In_x Ga_{1-x} N$ films with different In compositions were investigated using 325 nm laser line. For photon energy above the energy gap, strong enhanced $2A_1$ (LO) phonon scattering lines were observed. Four 2LO peaks shift from twice the energy of the first-order LO peak, to the high energy end and the shifts increase with In contents in the samples. It is attributed to the multiple resonance resulting from intraband-Fröhlich interaction. The composition dependence of LO phonon mode frequency and line shape was analysed. The phase separation was observed in Raman spectra and compared with the data of X-ray diffraction. Furthermore, the E_2 phonon combination mode of $In_x Ga_{1-x} N$ was observed at about 1310 cm⁻¹.

Keywords : $In_x Ga_{1-x} N$ alloy , ultraviolet resonant Raman scattering , second-order phonon , phase separation **PACC** : 7830 , 7280E

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10474078) and the Natural Science Foundation of Shaanxi Province, China (Grant No. 2004A01).

[†] E-mail :wangrm@mail.xjtu.edu.cn